

○国立大学法人筑波大学数理物質系におけるマテリアル先端リサーチインフラ登録設備の  
利用に関する細則

令和 4 年 4 月 1 日  
数理物質系部局細則第 2 号

(趣旨)

第1条 この部局細則は、文部科学省が実施する「マテリアル先端リサーチインフラ」に登録した筑波大学数理物質系（以下「系」という。）の研究設備（以下「登録設備」という。）の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業実施委員会)

第2条 登録設備の利用に係る事業を実施するため、マテリアル先端リサーチインフラ事業実施委員会（以下「委員会」という。）を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員で組織する。

- (1) マテリアル先端リサーチインフラ代表者（以下「代表者」という。）
- (2) 代表者の推薦する者のうちから数理物質系長が指名する者 若干人
- (3) その他数理物質系長が指名する者 若干人

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、前条第2項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を主宰する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(委員の任期)

第4条 第2条第2項第2号及び第3号の委員の任期は、1年とする。ただし、任期の終期は、委員となる日の属する年度の末日とする。

2 第2条第2項第2号及び第3号の委員は、数理物質系長の指名により再任できる。

(利用課題申請)

第5条 登録設備を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、別に定める利用課題申請書により委員長に願い出なければならない。

(利用の許可)

第6条 委員長は、登録設備の利用の許可又は不許可を決定する。

2 委員長が利用の許可又は不許可の決定をしたとき、数理物質系長は利用条件を付して利用者  
に通知する。

3 登録設備の利用に当たり、委託利用の作業をモニタリングし利用者が必要な指示等を与える  
こと（以下「遠隔モニタリング」と言う。）を希望した場合、前項によりその旨を条件として通  
知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第7条 数理物質系長は、利用者がこの部局細則に違反したときは、その利用の許可を取り消し、  
又はその利用を停止することができる。

(利用期間)

第8条 登録設備の利用許可期限は、利用の許可の日の属する年度の末日とする。ただし、引き続き利用を希望する者は、委員長の許可を受け利用期間を延長することができる。

(利用課題又は内容の変更)

第9条 利用者は、委員長の許可を受け利用課題又は内容を変更することができる。

(利用料金)

第10条 利用者は、別に定める「マテリアル先端リサーチインフラ登録設備の利用料金に関する細則」の利用料金を納付しなければならない。

(利用の終了の報告)

第11条 利用者は、登録設備の利用を終了したときは、60日以内に別に定める報告書を委員長に提出しなければならない。

(登録設備の運転停止)

第12条 委員長は、登録設備の事故等により運転の支援業務の継続が困難となったときは、利用者に対して速やかにその旨を通知するものとする。

(利用者の責務)

第13条 利用者は、国立大学法人筑波大学（以下「本学」という）及び利用者の所属する機関の研究者倫理及び研究活動に係る規則を遵守しなければならない。

- 2 利用者は、登録設備の利用において、研究活動上の不正行為（故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、捏造（存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。）、改ざん（研究資料、研究機器、研究過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。）又は盗用（他人のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、了解若しくは適切な表示なく流用することをいう。）を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。
- 3 利用者は、前項以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの（不適切なオーサーシップ及び二重投稿等）を行ってはならない。
- 4 前3項に定めのない事項については、筑波大学研究公正規則（平成19年法人規則第1号）を準用する。

(秘密保持)

第14条 本学及び利用者は、登録設備の利用により知り得た情報のうち相手方より秘密の取扱いの下に開示された情報は、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示しないものとする。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

- (1) 既に公知であったもの
- (2) 自己の責めによらず公知となったもの
- (3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- (4) 既に自己が所有していたもの
- (5) 相手方から知り得た情報によらず独自に創出又は発見したことが書面等により立証できるもの

(6) 公的機関に報告する法的義務があるもの及び公的機関により開示を命じられたもの

(知的財産権の帰属等)

- 第15条 利用者が登録設備の利用により得られた知的財産権は、原則として利用者に帰属するものとする。ただし、当該利用のために行った設備の実験装置及び測定方法の改良等が本学の職員による場合のノウハウ等の知的財産権の帰属は、双方の貢献度を踏まえて系長と利用者との協議するものとし、特許出願等を行う場合は、事前に本学の承認を得るものとする。
- 2 本学及び利用者が登録設備の利用により共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権（以下「共有に係る知的財産権」という。）は本学及び利用者の共有とし、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、共有に係る知的財産権に係る本学及び利用者の持分等を定めた共同出願契約を別途締結するものとする。

(成果の利用等)

- 第16条 利用者は、登録設備の利用により得られた成果等を公開するときは、「国立大学法人筑波大学数理物質系におけるマテリアル先端リサーチインフラ登録設備」を利用したものであることを明記しなければならない。
- 2 利用者は、登録設備の利用により得られた成果等が、特許出願、特許取得、製品化等につながった場合には、各段階において速やかに委員長に報告しなければならない。

(知的財産権の実施)

- 第17条 利用者は、共有に係る知的財産権について実施しようとするときは、別途実施契約を締結するものとする。
- 2 本学は、研究又は教育に係る場合を除いて、共有に係る知的財産権について実施しないものとする。
- 3 本学及び利用者は、共有に係る知的財産権について、相手方の同意を得て第三者にその実施を許諾することができる。
- 4 本学及び利用者は、共有に係る知的財産権を第三者又は利用者の指定する者に実施させる場合は、その持分に応じた実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施契約を当該者と別途締結するものとする。

(知的財産権の管理)

- 第18条 共有に係る知的財産権のうち本学の持分に係る知的財産権の管理については、本学の定めるところによる。

(損害賠償等)

- 第19条 利用者が故意又は過失により登録設備を汚損し、破損し、又は紛失したときは、原状に回復し、又はその損害に相当する費用を賠償しなければならない。

(雑則)

- 第20条 この部局細則に定めるもののほか、登録設備の利用に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

- 1 この部局細則は、令和4年4月1日から施行する。
- 2 国立大学法人筑波大学数理物質系におけるナノテクノロジープラットフォーム共用施設の利用に関する細則（平成26年1月10日数理物質系部局細則第1号）は廃止する。

国立大学法人筑波大学数理物質系におけるマテリアル先端リサーチインフラ登録設備の  
利用料金に関する細則

令和 4 年 4 月 1 日

数理物質系部局細則第 3 号

改正 令和 5 年数理物質系部局細則 2 号

改正 令和 6 年数理物質系部局細則 1 号

改正 令和 7 年数理物質系部局細則 1 号

(趣旨)

第 1 条 国立大学法人筑波大学数理物質系におけるマテリアル先端リサーチインフラ登録設備の利用に関する細則（令和 4 年数理物質系部局細則第 2 号）第 10 条に基づき文部科学省が実施する「マテリアル先端リサーチインフラ」に登録した筑波大学数理物質系の研究設備（以下「登録設備」という。）の利用料金等に関し必要な事項を定める。

(利用料金)

第 2 条 登録設備を利用した者は、別表に定める利用料金を次の各号により負担しなければならない。

- ① 学内利用者は、別表第 1 に定める学内利用料金の区分とする。
- ② 学外利用者は、別表第 1 に定める学外利用料金の区分とし、知財等の扱いで成果の公開を望まない場合には成果非公開の扱いとし、成果非公開、成果公開により利用料金を区分する。さらに、登録設備の利用に関し、自ら機器を操作し機器利用した場合と機器の操作の技術補助又は代行の場合とに分け利用料金を区分する。
- ③ 別表第 2 に定める機器の学外の利用にあたっては、マテリアルデータベースの構築に賛同し機器を利用して得られたデータの本学に提供がある場合には、前号にかかわらず利用料金は同表に定める額とする。
- ④ 登録設備の利用にあたって、遠隔モニタリング、遠隔操作が必要な場合、利用者は、別表第 1 又は別表第 2 に定める利用料金のほか、別表第 3 及び別表第 4 に定める必要な経費を負担しなければならない。
- ⑤ 前号までの規定にかかわらず、系長が特に必要があると認めるときは、利用負担金の一部又は全部を負担させないことができる。

(負担方法)

第 3 条 利用負担金の負担方法は、国立大学法人筑波大学出納命令役の発する請求書によるものとする。

(雑則)

第 4 条 この部局細則に定めるもののほか、登録設備の利用に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この部局細則は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この部局細則は、令和 5 年 6 月 9 日から施行し、同年 4 月 1 日から適用する。

附 則

- 1 この部局細則は、令和6年4月12日から施行し、同年4月1日から適用する。
- 2 マテリアル先端リサーチインフラ共有設備については、オープンファシリティとして安価に利用者に機器を提供することとしている。このことに鑑みて、令和6年4月1日付け筑波大学における人件費単価の改定に伴う利用料金の反映については、当分の間従前の計算に基づくものとする。

附 則

この部局細則は、令和7年4月1日から施行する。

## 別表第1

筑波大学数理物質系マテリアル先端リサーチインフラ登録設備利用料金表

登録設備の名称	学内 利用料金 (円/30分)	学外利用料金			
		成果非公開		成果公開	
		機器利用 (円/30分)	技術補助・ 代行 (円/30分)	機器利用 (円/30分)	技術補助・ 代行 (円/30分)
デバイスシミュレーター	330	5,000	7,000	860	3,700
スパッタリング装置	750	7,000	9,000	1,700	4,500
FIB-SEM	2,250	15,000	17,000	5,680	8,500
電子線蒸着装置	750	6,500	8,500	1,540	4,400
電子線描画装置	750	7,000	9,000	1,680	4,500
走査型プローブ顕微鏡	750	7,000	9,000	1,740	4,500
ウェーハダイシングマシン	300	4,500	6,500	650	3,500
電界放出型走査電子顕微鏡	750	7,000	9,000	1,780	4,600
パターン投影リソグラフィシステム	250	4,500	6,500	530	3,300
インクジェットパターン形成装置	750	6,500	8,500	1,470	4,300
マスクアライナー	150	4,000	6,000	220	3,000
反応性エッチング装置	540	5,500	7,500	930	3,700
半導体特性評価システム	150	4,500	6,500	510	3,300
触針式表面形状測定器	100	4,000	6,000	210	3,000
光電子分光装置	200	6,000	8,000	1,160	4,000
パワーデバイス特性評価装置	200	5,000	7,000	820	3,600
IR エミッション顕微鏡	500	7,500	9,500	2,060	4,900
イオンミリング	500	6,000	8,000	1,310	4,100
分光エリブソメータ	400	5,000	7,000	750	3,600
顕微ラマン	650	5,000	7,000	730	3,500
超高温炉	500	7,500	9,500	2,150	5,000
小型イオンシャワー	750	5,500	7,500	1,130	3,900
多機能走査型X線光電子分光分析装置	500	8,000	10,000	2,370	5,200
10kV 計測システム	500	6,000	8,000	1,400	4,200
データ解析用PC	100	4,000	6,000	250	3,100

注) 上記金額には、消費税を含む。

別表第2

筑波大学数理物質系マテリアル先端リサーチインフラ登録設備利用料金表（データ登録）

登録設備の名称	学外利用料金	
	成果公開・データ登録あり	
	機器利用 (円/30分)	技術補助・代行 (円/30分)
デバイスシミュレーター	700	3,300
スパッタリング装置	1,500	4,100
FIB-SEM	5,100	7,700
電子線蒸着装置	1,300	4,000
電子線描画装置	1,500	4,100
走査型プローブ顕微鏡	1,500	4,100
ウェーハダイシングマシン	500	3,200
電界放出型走査電子顕微鏡	1,600	4,100
パターン投影リソグラフィシステム	400	3,000
インクジェットパターン形成装置	1,300	3,900
マスクライナー	100	2,700
反応性エッチング装置	800	3,300
半導体特性評価システム	400	3,000
触針式表面形状測定器	100	2,700
光電子分光装置	1,000	3,600
パワーデバイス特性評価装置	700	3,200
IR エミッション顕微鏡	1,800	4,400
イオンミリング	1,100	3,700
分光エリプソメータ	600	3,200
顕微ラマン	600	3,200
超高温炉	1,900	4,500
小型イオンシャワー	1,000	3,500
多機能走査型 X 線光電子分光分析装置	2,100	4,700
10kV 計測システム	1,200	3,800
データ解析用 PC	200	2,800

注) 上記金額には、消費税を含む。

注) データ登録は「国立大学法人筑波大学 マテリアル先端リサーチインフラデータ登録約款」に従う。

別表第3

筑波大学数理物質系マテリアル先端リサーチインフラ登録設備利用負担金

登録設備の名称	遠隔操作利用負担金	作業時間が3時間を超える場合の超過時間分の付加金
FIB-SEM	11,400円/1件	3,800円/30分

注) 上記金額には、消費税を含む。

別表第4

筑波大学数理物質系マテリアル先端リサーチインフラ登録設備利用負担金

登録設備の名称	遠隔モニタリング付加金	備考
FIB-SEM	11,400円/1件	

注) 上記金額には、消費税を含む。